二成分混合界面活性剤水溶液の表面吸着とミセル形成(第3報) ードデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムとアルキルスルホン酸ナトリウム系ー

松尾 洋·越智 友佳

Surface Adsorption and Micelle Formation in Aqueous Solution of Two-ComponentMixed Surfactants. II. Dodecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt - Alkylsulfonic Acid Sodium Salt System.

Hirosi MATUO · Tomoka OCHI

Summary

To make clear the effect of the chain length and benzene ring on the miscibility in aqueous solution of two-component mixed surfactants, the surface tension of the aqueous solution of dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt and alkylsulfonic acid sodium salt mixture was measured as a function of the total molality and composition of the surfactants. The amounts of adsorption at the air/water interface and the compositions in the mixed adsorbed film and micelle were caluculated by useof the thermodynamic equations. It was concluded that the composition in the mixed adsorbed film and micelle were strongly affected by the difference in the surface tension-concentration curve between two components.

1.緒言

二成分混合界面活性剤水溶液系について、第1報¹¹ では、陰イオン性界面活性剤/非イオン性界面活性 剤系について、ミセル組成ーバルク組成曲線に極大 が存在することから、二成分間の相互作用が純成分 間の相互作用より強いことを示した。また、第2報²¹ では、陰イオン性界面活性剤/陰イオン性界面活性 剤系と両性界面活性剤/陽イオン性界面活性剤系に ついて、表面張力-濃度曲線と吸着膜の組成及びミ セルの組成との関連を調べた。

本研究では、炭化水素鎖の末端にベンゼン環を持 つ陰イオン性界面活性剤と、直鎖で炭化水素鎖長の 異なる陰イオン性界面活性剤の二成分混合水溶液系 について、表面吸着とミセル形成に及ぼす炭化水素 鎖長の影響を調べた。

界面活性剤の分子間相互作用には、親水性部分の 寄与と疎水性部分の寄与の二種類がある。本研究で は、主に、炭化水素鎖長の長短という疎水性部分の 相互作用を調べるため、同じ親水基を持つ陰イオン 性界面活性剤を使用することにより、相互作用にお ける親水性部分の寄与を同様にした。

2.実験

2-1 試料及び表面張力の測定

陰イオン性界面活性剤は、親水基がスルホン酸ナ トリウムのものを使用した。ベンゼン環を持つ界面 活性剤にはドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)、直鎖の界面活性剤には、炭素数がそれぞ れ8、10、12、16のオクタンスルホン酸ナトリウム (C8)、デカンスルホン酸ナトリウム(C10)、ドデカン スルホン酸ナトリウム(C12)、ヘキサデカンスルホン 酸ナトリウム(C16)を使用した。これらの試薬は、全 て東京化成工業より購入した。

水溶液の表面張力は、協和界面科学のWilhelmy型 表面張力計(CBV式、A-3型)で測定した。測定誤差 は±0.2 mN/mであった。測定温度は、溶解度の関係 でヘキサデカンスルホン酸ナトリウム(C16)について のみ50℃であったが、それ以外は全て20℃であった。 なお、測定には二次蒸留水を使用した。

2-2 吸着量、吸着膜の組成、ミセルの組成の算出 解析には、ハンセンの取り扱いを発展させた本村 の式³⁻⁷⁾を利用した。吸着量 Г^H、吸着膜の組成x^H、 ミセルの組成x^M、cmcにおける吸着膜の組成x^{H,cmc} を算出する際に使用した式を、それぞれ以下に示し た。なお、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)を第1成分に、アルキルスルホン酸ナトリウ ム(C8、C10、C12、C16)を第2成分とした。

1)吸着量 Г "は、

 $\Gamma^{H} = -(m/2RT)(\partial \gamma / \partial m)_{TP,X_{2}}$ (1) より算出した。Rは気体定数、Tは絶対温度、pは大 気圧、 γ は表面張力、m は重量モル濃度、 x_{2} はバル ク中での第2成分のモル分率である。

2)吸着膜の組成x₂^Hは、

$$\mathbf{x}_{2}^{H} = \mathbf{x}_{2} - [(1 - \mathbf{x}_{2}) \mathbf{x}_{2} / \mathbf{RT} \Gamma^{H}] (\partial \gamma / \partial \mathbf{x}_{2})_{\mathrm{T,P,m}}$$
(2)

より算出した。

3)ミセルの組成x,[™]は、

$$\mathbf{x}_{2}^{M} = \mathbf{x}_{2} - [2(1-\mathbf{x}_{2})\mathbf{x}_{2}/\text{cmc}](\partial \text{cmc}/\partial \mathbf{x}_{2})_{\text{TP}}$$
(3)

より算出した。なお、cmc は臨界ミセル濃度である。 4)cmcにおける吸着膜の組成x、^{H.cmc}は、

$$\mathbf{x}_{2}^{\mathrm{H,cmc}} = \mathbf{x}_{2}^{\mathrm{M}} - \left[(1 - \mathbf{x}_{2}) \, \mathbf{x}_{2} / \mathrm{RT} \, \Gamma^{\mathrm{H,cmc}} \right] (\partial \gamma_{\mathrm{cmc}} / \partial \mathbf{x}_{2})_{\mathrm{T,P}}$$

$$(4)$$

より算出した。なお、 $\Gamma^{\text{H.cmc}}$ はcmcでの吸着量、 γ_{mc} はcmcでの表面張力である。

3. 結果と考察

3-1 炭化水素鎖長

炭化水素鎖長の相互の関係を示すため、ベンゼン 環を持つドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)と直鎖で炭素数がそれぞれ8、10、12、16の アルキルスルホン酸ナトリウムについて、模式図と 構造式を図1に示した。



図1 界面活性剤の構造式と模造図

3-2 表面張力-濃度曲線

1)一成分系

ベンゼン環を持つドデシルベンゼンスルホン酸ナ トリウム(C12Be)と直鎖のオクタンスルホン酸ナト リウム(C8)、デカンスルホン酸ナトリウム(C10)、ド デカンスルホン酸ナトリウム(C12)、ヘキサデカンス ルホン酸ナトリウム(C16)について、表面張力–濃度 曲線(γ-log C 曲線)を図2に示した。測定温度は、 ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム(C16)のみが50℃ で、それ以外は20℃であった。



表面張力ー濃度曲線は、低濃度側から、炭化水素 鎖長の長い順に、ヘキサデカンスルホン酸ナトリウ ム(C16) < ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be) < ドデカンスルホン酸ナトリウム(C12) < デ カンスルホン酸ナトリウム(C10) < オクタンスルホン 酸ナトリウム(C8)の順であった。また、表面張力ー 濃度曲線の折れ曲がり点での濃度である臨界ミセル 濃度(cmc)と表面張力(γ_{cmc})を表1に示した。

表1 界面活性剤の臨界ミセル濃度 (cmc) と表面張 力 (γ_m)

界	đá	活	性	剤	臨昇ミセル 濃度 m mol / l	表面優力 ycac mN / m	<u>温</u> 度 で
オクタン	スルホ	ン酸ナ	トリウ	4	150	40.2	20
デカンス	ルホン	使ナト	リウム		14.0	33.4	20
ドデカン	スルホ	ン酸ナ	トリウ	4	10.0	34.0	20
ヘキサデ	カンス	ルホン	酸ナト	リウム	1.0	33.0	50
ドデシル	ベンセ	シスル	ホン蘭	ナトリウム	1.8	33.5	20
		n			1.9	32.0	50
					1	1	1

2)二成分系

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)/オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系、ド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ド デカンスルホン酸ナトリウム(C12)系、それに、ドデ シルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ヘキ サデカンスルホン酸ナトリウム(C16)系について、表 面張力-濃度曲線(γ-log C曲線)を、それぞれ 図3、4、5に示した。

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系では、表面張 カー濃度曲線は第2成分(オクタンスルホン酸ナト リウム)の組成の増加とともに高濃度側にシフトし たが、第2成分の組成が0.8とかなり大きくなっても ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(第1成分) の表面張力ー濃度曲線に近い曲線を示したことか ら、第1成分の影響が強いことが分かった。また、 臨界ミセル濃度(cmc)での表面張力(γ_{cmc})には 極小が存在した。



図3 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/オ クタンスルホン酸ナトリウム系の表面張力--濃度曲線(20℃)

次に、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)/ドデカンスルホン酸ナトリウム(C12)系で は、ドデカンスルホン酸ナトリウム(C12)の表面張力 ー濃度曲線がオクタンスルホン酸ナトリウム(C8)よ り低濃度側にシフトした点を除き、上記の系と同様 の挙動を示した。



図4 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ド デカンスルホン酸ナトリウム系の表面張力— 濃度曲線(20℃)

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)/ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム(C16) 系では、第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナトリ ウム)の表面張力ー濃度曲線が第1成分(ドデシル ベンゼンスルホン酸ナトリウム)より低濃度側に位 置するため、第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナ トリウム)の組成の増加とともに低濃度側にシフト した。また、臨界ミセル濃度(cmc)での表面張力 γ_{cme}は、第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナトリウ ム)の組成の増加とともに極く僅かではあるが極小 を示した。



図5 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ヘ キサデカンスルホン酸ナトリウム系の表面張 力→濃度曲線(20℃)

3-3 表面張力一組成曲線

吸着膜の組成を算出するためには、(2)式より、表面張力の組成微分の値($\partial \gamma / \partial x_2$) T,p,mが必要である。図上微分によりこの値を求めるため、表面張力ー濃度曲線(図3、4、5等)から一定濃度での表面張力ー組成曲線を作成した(図6、7)。なお、界面活性剤の溶存状態は、 $\gamma_{cmc} - x_2$ 曲線(点線)より上の領域がモノマー状態で、 $\gamma_{cmc} - x_2$ 曲線(点線)より下の領域がミセル状態である。

ドシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系(図6)では、 第2成分(オクタンスルホン酸ナトリウム)の組成 の増加とともに表面張力が増加した。これは、第1 成分(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)の 方が第2成分(オクタンスルホン酸ナトリウム)よ り疎水性が強いため、第2成分の組成の増加ととも に空気/水界面で第2成分の吸着量が増加しても表 面張力はあまり低下しないからである。また、濃度 の増加とともに表面張力が減少したのは、吸着量が 増加するためである。

ド デ シ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 ナ ト リ ウ ム (C12Be)/ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム(C16) 系(図7)では、第2成分(ヘキサデカンスルホン酸 ナトリウム)の方が第1成分(ドデシルベンゼンス ルホン酸ナトリウム)より疎水性が強いため、第2 成分(ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム)の組成 の増加とともに表面張力が低下した。



図6 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/オ クタンスルホン酸ナトリウム系の表面張力― 組成曲線(20℃)



図7 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ヘ キサデカンスルホン酸ナトリウム系の表面張 力─組成曲線(20℃)

3-4 濃度一組成曲線

ミセルの組成を算出するためには、(3)式より、臨 界ミセル濃度(cmc)の組成微分の値(∂ cmc $/\partial$ x₂) T,pが必要である。先ほどと同様に、図上微分により この値を求めるため、表面張力ー濃度曲線(図3、4、 5等)から一定表面張力での濃度ー組成曲線を作成 した(図8、9)。なお、界面活性剤の溶存状態は、 cmc-x₂曲線(点線)より上の領域がモノマー状態 で、cmc-x₄曲線(点線)より下の領域がミセル状 態である。

ドシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系(図8)では、 第2成分(オクタンスルホン酸ナトリウム)の組成 の増加とともに濃度が増加した。これは、第1成分 (ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)の方が 第2成分(オクタンスルホン酸ナトリウム)より疎 水性が強いため、第2成分(オクタンスルホン酸ナ トリウム)の組成の増加とともに、一定表面張力に 到達するために第2成分の吸着量が増加しなければ ならないからである。また、表面張力が増加すると ともに濃度が減少したのは、吸着量が少なくなるか らである。

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)/ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム (C16)系(図9)では、第2成分(ヘキサデカンス ルホン酸ナトリウム)の方が第1成分(ドデシル ベンゼンスルホン酸ナトリウム)より疎水性が 強いため、第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナ トリウム)の組成の増加とともに濃度が減少し た。



図8 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/オ クタンスルホン酸ナトリウム系の濃度―組成 曲線(20℃)



図9 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ヘ キサデカンスルホン酸ナトリウム系の濃度─ 組成曲線(20℃)

3-5 吸着量

ドシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系とドデシルベ ンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ヘキサデカ ンスルホン酸ナトリウム(C16)系について、吸着量-濃度曲線(Γ^H-log C 曲線)を図10と11に示した。

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系(図10)では、 低濃度側でドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)の吸着量がオクタンスルホン酸ナトリウム (C8)の吸着量より遙かに大きかった。これは、炭化 水素鎖長の長いドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ ウム(C12Be)の方がオクタンスルホン酸ナトリウム (C8)より疎水性が強いためである。ところが高濃度



log C / mol/l

図10 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/オ クタンスルホン酸ナトリウム系の吸着量─組 成曲線(20℃)



log C / mol/l

図11 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ヘ キサデカンスルホン酸ナトリウム系の吸着量 一組成曲線(20℃)

側では、逆に、オクタンスルホン酸ナトリウム(C8) の吸着量がドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)より大きかった。これは、空気/水界面に おける"起きた状態"での分子占有面積は、ベンゼ ン環を持つドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)より直鎖の方が小さいため、単位面積あた りの吸着量はオクタンスルホン酸ナトリウム(C8)の 方が大きいからである。なお、ドデシルベンゼンス ルホン酸ナトリウム(C12Be)/ヘキサデカンスルホ ン酸ナトリウム(C16)系では、測定した全濃度範囲に わたり、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム (C12Be)の吸着量がヘキサデカンスルホン酸ナトリ ウム(C16)の吸着量より大きかった(図11)。これは、 ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム(C16)は直鎖では あるが炭化水素鎖長が長いため、吸着状態での分子 占有面積が若干大きくなったことに起因すると思わ れる。

3-6 吸着膜の組成

ー定濃度での表面張力ー組成曲線(図6、7等)の 傾きと(2)式を利用して吸着膜の組成を算出し、バル クの組成に対してプロットしたのが図12である。な お、x₂はバルク中での第2成分のモル分率、x₂⁺は吸 着膜中での第2成分のモル分率を示している。

ド デ シ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 ナ ト リ ウ ム (C12Be)/オクタンスルホン酸ナトリウム(C8)系とド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/ド デカンスルホン酸ナトリウム(C12)系では、バルクの 組成と比較して、吸着膜中に疎水性の強い第1成分 (ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)が多く 含まれていた。また、吸着膜の組成とバルクの組成 の差は、表面張力-濃度曲線の位置が離れているド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12Be)/オ クタンスルホン酸ナトリウム(C8)系が大きく、表面



図12 一定濃度(1.0m mol/l) での表面張力一組成 曲線

- ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /オクタンスルホン酸ナトリウム系(20℃)
- 2.ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /ドデカンスルホン酸ナトリウム系(20℃)
- ボデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム系(50℃)



- **図13** 一定濃度(1.0m mol/l) でのバルクの組成と 吸着膜の組成の差
- ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /オクタンスルホン酸ナトリウム系(20℃)
- 2.ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /ドデカンスルホン酸ナトリウム系(20℃)
- 3.ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム /ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム系(50℃)

張力-濃度曲線の位置が近いドデシルベンゼンスル ホン酸ナトリウム(C12Be)/ドデカンスルホン酸ナ トリウム(C12)系が小さかった。ドデシルベンゼンス ルホン酸ナトリウム(C12Be)/ヘキサデカンスルホ ン酸ナトリウム(C16)系でも、同様に、疎水性の強い 第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナトリウム)が 吸着膜に多く含まれていた(図12)。

バルクの組成と吸着膜の組成の差を図13に示し た。各系ともドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウ ム(第1成分)が共通に含まれている。縦軸の正の 値は、バルクの組成と比較して、吸着膜中に第1成 分(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)が多 く含まれることを示しており、また、負の値は吸着 膜中に第2成分(ヘキサデカンスルホン酸ナトリウ ム)が多く含まれることを示している。炭化水素鎖 長が最も短い系が最大の値を示し、炭化水素鎖長が 増加とともに減少した。また、炭化水素鎖長が最長 のヘキサデカンスルホン酸ナトリウムでは負の値を 示した(図13)。このように、表面張力-濃度曲線 が低濃度側に位置する成分の方が空気/水界面で選 択的に吸着されるという結果は、前報²¹と同様であ った。

3-7 ミセルの組成、及び、cmcにおける吸着 膜の組成とミセルの組成

ミセルの組成をバルクの組成に対してプロットしたのが図14、15、16の実線である。ここで、x,はバルク中での第2成分のモル分率、x,^Mはミセル中での 第2成分のモル分率を示している。また、縦軸の正の値は、バルクの組成と比較して、ミセル中に第1 成分(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)が 多く含まれることを示しており、負の値はミセル中 に第2成分が多く含まれることを示している。

次に、cmcにおける吸着膜の組成をバルクの組成 に対してプロットしたのが図14、15、16の一点鎖線 である。ここで、x₂^{H.cmc}はcmcにおける吸着膜中で の第2成分のモル分率を示している。縦軸の正の値 は、バルクの組成と比較して、cmcにおける吸着膜 中に第1成分(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ ウム)が多く含まれることを示しており、負の値は cmcにおける吸着膜中に第2成分が多く含まれること を示している。

さらに、cmcにおける吸着膜の組成とミセルの組 成の差をプロットしたのが図14、15、16の点線であ る。縦軸の正の値は、ミセルの組成と比較して、 cmcにおける吸着膜中に第1成分(ドデシルベンゼン スルホン酸ナトリウム)が多く含まれることを示し ており、負の値はcmcにおける吸着膜中に第2成分が 多く含まれることを示している。

図14、15、16より、ミセルの組成もcmcにおける 吸着膜の組成も、前報²¹の結果と同様に、表面張力 ー濃度曲線が低濃度側に位置する疎水性の強い成分 の方が、ミセル及び吸着膜に多く含まれていた。ま た、成分の表面張力ー濃度曲線の位置が離れている 系では組成の差が大きく、逆に、表面張力ー濃度曲 線の位置が近い系では組成の差が小さかった。



図14 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/オ クタンスルホン酸ナトリウム系でのバルグの 組成及びcmcにおける吸着膜の組成(20℃)



図15 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ド デカンスルホン酸ナトリウム系でのバルグの 組成及びcmcにおける吸着膜の組成(20℃)



図16 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム/ヘ キサンスルホン酸ナトリウム系でのバルグの 組成及びcmcにおける吸着膜の組成(20℃)

以上の結果から、二成分混合界面活性剤水溶液に ついて、(1)吸着膜の組成及びミセルの組成の挙動は、 成分の表面張力ー濃度曲線の位置関係に規定される こと、(2)表面張力ー濃度曲線が低濃度側に位置する 成分の方が、空気/水界面及びミセル中で多く含ま れること、また、(3)吸着膜の組成の差の方がミセル の組成の差より大きいことが分かった。

本研究の一部は、第46回日本家政学会中国・四国 支部研究発表会(平成11年10月3日、四国大学)で 発表した。

参考文献

- 1) 松尾 洋:山口女子大学家政学部研究報告、20, 69 (1994).
- 2) 松尾 洋:山口県立大学生活科学部研究報告、
 24, 21 (1998).
- 3) K.Motomura, H.Matsukiyo, and M.Aratono, ACS Symp. Ser., 311,163 (1986).
- 4) M.Aratono, T.Okamoto, and K.Motomura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 60, 2361 (1989).
- 5) M.Aratono, T.Okamoto, N.Ikeda and K.Motomura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 61, 2773 (1989).
- 6) N.Ikeda, E.Shiota, M.Aratono, and K.Motomura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 62, 410 (1989).
- 7) K.Abe, H.Matsukiyo, N.Ikeda, M.Aratono, and K.Motomura, Bull. Chem. Soc. Jpn., 64, 2882 (1991).